

高品質PXP成膜装置

High Quality PXP Coater

EPC-100



■特長

- ・CVD法による高品質ポリパラキシリレン薄膜の成膜装置です。
- ・電子デバイス内の各種絶縁部材(ゲート絶縁層等)や封止に最適

■仕様

- 到達圧力 10^{-5} Pa台
- チャンパー寸法 $\phi 253 \times 350$ mm
- 高分子蒸着源 石英管 $\phi 50 \times 1000$ mm程度
- 高分子蒸着源用 ... 加熱温度 最高 200°C
ヒーター (パイプ用マントルヒーター加熱)
- チラーユニット 温度設定範囲 $-20^{\circ}\text{C} \sim 30^{\circ}\text{C}$
- コールドトラップ 4インチ